# Japan Patent Office Patent Gazette

Patent No.

2793773

Date of Registration:

June 19, 1998

Date of Publication of Gazette:

September 3, 1998

International Class(es):

C23C 14/06 B23B 27/14 B23P 15/28 C23C 14/32

(6 pages in all)

Title of the Invention:

HARD FILM, HARD FILM COATED TOOL AND HARD FILM COATED MEMBER EXCELLENT IN WEAR

RESISTANCE

Patent Appln. No.

06-100154

Filing Date:

May 13, 1994

Inventor(s):

Yusuke TANAKA, Yasuyuki YAMADA,

and Taiji ONISHI

Patentee(s):

SHINKO KOBELCO TOOL KABUSHIKI

KAISHA

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

<sup>\*</sup>Attached is an English abstract of the laid-open application.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

C 2 3 C 14/06

B 2 3 B 27/14

# (12) 特 許 公 報 (B 2)

FΙ

C23C 14/06

B 2 3 B 27/14

# 第2793773号

(45)発行日 平成10年(1998) 9月3日

識別記号

(24)登録日 平成10年(1998)6月19日

Н

B 2 3 P 15/28	}	B 2 3 P 15/20	B A
C 2 3 C 14/32	2	C 2 3 C 14/3	B B
			謝求項の数4(全 6 頁)
(21)出顯番号	<b>特顧平6-100154</b>	(73)特許権者	596091392
			神鋼コペルコツール株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)5月13日		兵庫県明石市魚住町金ヶ崎西大池179-
			1
(65)公開番号	特開平7-310174	(72)発明者	田中裕介
(43)公開日	平成7年(1995)11月28日		兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
審查請求日	平成8年(1996)1月23日		1 株式会社神戸製鋼所 明石工場内
		(72)発明者	山田 保之
			兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
			1 株式会社神戸製鋼所 明石工場内
		(72)発明者	大西 泰司
			兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
			1 株式会社神戸製鋼所 明石工場内
		(74)代理人	弁理士 小谷 悦司 (外2名)
		審査官	三宅 正之
			最終質に続く

# (54) 【発明の名称】 耐摩耗性に優れた硬質皮膜、硬質皮膜被覆工具及び硬質皮膜被覆部材

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材表面に形成される皮膜であって、

(Alx Ti1-x-y Siy) (Nz C1-z)但し、0.05≦x≦0.75 0.  $0.1 \le y \le 0.1$ 

 $0. \quad 6 \leq z \leq 1$ 

で示される化学組成からなることを特徴とする耐摩耗性 に優れた硬質皮膜。

【請求項2】 皮膜の厚さが0.1~20µmである請 求項1記載の硬質皮膜。

ーク放電方式イオンプレーティング法により基材表面に 形成してなることを特徴とする耐摩耗性に優れた硬質皮 膜被覆工具。

【請求項4】 請求項1または2記載の硬質皮膜を、ア - ク放電方式イオンプレーティング法により基材表面に 形成してなることを特徴とする耐摩耗性に優れた硬質皮 膜被覆部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【請求項3】 請求項1または2記載の硬質皮膜を、ア 10 【産業上の利用分野】本発明は、フライス加工,切削加 工、穿孔加工等の加工に使用される切削工具の表面被覆 材、或は金型, 軸受け, ダイス, ロールなど高硬度が要 求される耐摩耗部材の表面被覆材、もしくは成形機用ス クリューやシリンダ等の耐熱・耐食部材の表面被覆材と して有用な硬質皮膜、及び該硬質皮膜を被覆することに

よって優れた耐摩耗性を発揮する硬質皮膜被覆工具及び 硬質皮膜被覆部材に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】高速度工具や超硬合金工具など高い耐摩 耗性が要求される切削工具は、工具の基材表面にTiN やTiC等の硬質皮膜を形成することにより耐摩耗性の 向上が図られている。上記TiNとTiCの耐摩耗性を 比較すると、TiNは高温域における耐酸化性の点でT iCより優れており、切削時の加工熱や摩擦熱によって 生じる工具すくい面のクレータ摩耗に対して耐摩耗性を 10 た。 発揮する。しかもTiNは母材との密着性にも優れてい る。一方TiCはTiNより硬度が高く、被削材と接す る逃げ面のフランク摩耗に対して高い耐久性を有してい る。しかしながら耐酸化性に優れたTiNであっても酸 化開始温度は600℃程度であり、また高い硬度を有す るTiCであってもそのビッカース硬さは2000程度 であり、耐摩耗性の一層の改善が望まれていた。

【0003】そこで例えば特開平2-194159に は、TiNやTiCの耐酸化性や硬度の向上を目的とし て、Tiの一部をAlに置換したAl, Tiの複合窒化 20 物や複合炭窒化物「以下(Al. Ti)(C,N)と示 す〕が開示されており、酸化開始温度は約800℃、ビ ッカース硬さは約2500kg/mm² という特性を示 す硬質皮膜が開発されている。但し一層の高能率化が要 求されている切削加工などの分野では、より優れた耐摩 耗性を有する硬質皮膜の開発が期待されていた。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこうした事情 に着目してなされたものであって、TiN皮膜の有する 母材密着性を損なうことなく、(Al, Ti)(C, N) より耐酸化性に優れしかも高硬度を有して優れた耐 摩耗性を発揮する硬質皮膜を提供することを目的とする ものである。

# [0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成し得た本 発明に係る耐摩耗性に優れた硬質皮膜とは、基材表面に 形成される皮膜であって、

(Alx Til-x-y Siy) (Nz Cl-z)

但し、0.05≦x≦0.75

 $0. 01 \le y \le 0.1$ 

#### $0.6 \le z \le 1$

で示される化学組成からなることを要旨とするものであ

【0006】尚上記硬質皮膜の厚さは0.1~20μm にすることが好ましく、また上記硬質皮膜を、アーク放 電方式イオンプレーティング法により基材表面に形成す れば耐摩耗性に優れた硬質皮膜被覆工具及び硬質皮膜被 覆部材を得ることができる。

## [0007]

耗性をより一層向上させることを目的として、耐摩耗性 向上に有効な添加元素を検索した結果、(Al, Ti) (C, N) にSiを微量含有させた炭・窒化物は硬度が 高く、しかも酸化開始温度も高くなることを見出し、硬 質皮膜の組成が(Alx Til-x-y Siy)(NzC1-z) で示される化学式において $0.05 \le x \le 0.75$ , 0. 01≤y≤0.1,0.6≤z≤1を満足する場合 は、高硬度で耐酸化性の良好な硬質皮膜となり優れた耐 摩耗性を発揮することを突き止め、本発明を完成させ

【0008】さらに本発明に係る硬質皮膜はTiNの有 する優れた基材密着性も損なうことがないので、金型や 工具および耐摩耗部材等の基材表面に適用した場合も剥 離の問題が生じず、皮膜の耐摩耗性を十分発揮する硬質 皮膜被覆工具及び硬質皮膜被覆部材を得ることができ

【0009】尚本発明の硬質皮膜が従来の皮膜に比べて 優れた耐摩耗性を発揮する理由としては十分に解明され たわけではないが、Siを第3の金属元素として含有さ せることにより髙温時におこるTiの酸化を抑制した り、Al酸化物からなる保護皮膜を著しく緻密化するか らであると考えられる。

【0010】本発明の硬質皮膜を構成する金属元素の組 成は、(Alx Til-x-y Siy)においてx, yが夫  $\not = 0.05 \le x \le 0.75, 0.01 \le y \le 0.1$ とい う条件式を満足することが必要である。 x の値が 0.0 5未満であるか、またはyの値が0.01未満では十分 な耐酸化性の向上効果を得ることができない。またxの 値が0.75を超えるか、またはyの値が0.1を超え 30 ると皮膜の結晶構造が立方晶から六方晶へ変化してしま い、皮膜硬さが低下して十分な耐摩耗性が得られない。 なお、xの下限値としては0.25が好ましく、0.5 6以上であることがより望ましい。 x の上限値としては 0. 75が好ましく、0. 7以下であることがより望ま しい。 y の下限値としては0.01が好ましく、0.0 2以上であることがより望ましい。 yの上限値としては 0. 08が好ましく、0. 05以下であることがより望

【0011】また本発明は上記金属元素の窒化物であっ 40 ても炭・窒化物であっても優れた耐摩耗性を発揮する が、炭・窒化物の場合、窒素の原子比率が60%以上で あることが必要である。即ちNz C1-z で O. 6 ≦ z ≦ 1を満足することが必要であり、zの値が0.6未満の 場合は皮膜の耐酸化性が低下してしまう。尚、zの値が 0. 8以上であると耐酸化性がより良好となる。

【0012】基材に被覆する場合の硬質皮膜の厚さとし ては、0.1μm以上20μm以下であることが好まし い。 0. 1 μ m未満であると耐摩耗性が十分発揮でき ず、一方20μmを超えると衝撃力によって硬質皮膜に 【作用】本発明者らは(A l, T i)(C, N)の耐摩 50 クラックが入ることがあり、望ましくない。なお、切削 工具に適用する場合、工具基材本来の切れ刃の特性を生かし且つ優れた耐摩耗性を得るには、硬質皮膜の厚さを好ましくは  $1 \mu$  m以上、更に好ましくは  $2 \mu$  m以上、また上限について  $1 2 \mu$  m以下、更に好ましくは、 $8 \mu$  m以下が望まれる。また本発明は硬質皮膜を形成する基材の材質を限定するものではないが、基材表面に密着性よく被覆し、優れた耐摩耗性を発揮させるためには超硬合金や高速度工具鋼、ダイス鋼、サーメット、セラミック等の硬質物質が適している。

【0013】尚本発明に係る硬質皮膜を基材表面に形成する方法としては、イオンプレーティング法やスパッタリング法等に代表されるPVD法が挙げられるが、例えばアーク放電式イオンプレーティング法を採用する場合には以下に例示する方法を用いればよい。即ち、アーク放電により蒸発源であるカソードからイオン化させたA1、TiおよびSiの金属成分を、N2 雰囲気および/またはCH4 雰囲気中でイオンプレーティングすることによって得ることができ、目的とする皮膜組成と同一金属組成のターゲットを使用すれば、安定した組成の皮膜が得られ易い。また基板にバイアス電位を印加すると、皮膜の密着性を一段と高めることができるので好ましい。尚、本発明はイオンプレーティング時のガス圧も特に限定するものではないが、1×10-3~5×10-2Torr程度が好ましく、この範囲内であれば耐摩耗性の一段と優れた高結晶性の緻密な硬質皮膜が得られ易い。

\*下記の実施例に限定されるものではなく、前・後記の趣旨に徴して適宜変更することは本発明の技術的範囲に含まれる。

6

[0015]

【実施例】

#### 実施例1

> 【0016】電子プルーブX線マイクロアナリシスおよびオージェ電子分光法により皮膜の組成を求めると共に、下記条件で酸化試験を行った。結果は表1に示す。 (酸化試験の条件)

20 温度範囲:室温~1300℃ 昇温速度:10℃/min雰囲気 :乾燥空気、大気圧 空気流量:150cc/min

> 【0017】 【表1】

【0014】以下実施例について説明するが、本発明は\*

Na.	カソード材質	反応ガス	皮膜組成	酸化開始温度 (℃)	硬き (Hv)	備考
1	A1 <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.4</sub>	N <sub>2</sub>	(A1 <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.4</sub> ) N	820	2720	AV- etc. Dat
2	A1 <sub>0.69</sub> Ti <sub>0.30</sub> Si <sub>0.005</sub>	N <sub>2</sub>	(A1 <sub>0.7</sub> Ti <sub>0.29</sub> Si <sub>0.007</sub> ) N	820	2480	從來例
3	A1 <sub>0.59</sub> Ti <sub>0.4</sub> Si <sub>0.01</sub>	N <sub>2</sub>	(A1 <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.39</sub> Si <sub>0.01</sub> ) N	910	3040	
4	Al <sub>0.59</sub> Ti <sub>0.4</sub> Si <sub>0.01</sub>	N2/CH4	(A1 <sub>0.6</sub> T1 <sub>0.39</sub> Si <sub>0.01</sub> ) (N <sub>0.8</sub> C <sub>0.2</sub> )	870	3180	実
5	A1 <sub>0.57</sub> Ti <sub>0.38</sub> Si <sub>0.05</sub>	N <sub>2</sub>	(A 1 <sub>0.57</sub> T i <sub>0.38</sub> S i <sub>0.05</sub> ) N	1020	2950	施
6	A1 <sub>0.57</sub> Ti <sub>0.38</sub> Si <sub>0.05</sub>	N2/CH4	(A1 <sub>0.57</sub> Ti <sub>0.38</sub> Si <sub>0.05</sub> )(N <sub>0.9</sub> C <sub>0.1</sub> )	950	3060	<del>18</del> 1
7	A1 0.54T i 0.36 S i 0.1	N <sub>2</sub>	(A1 <sub>0.54</sub> Ti <sub>0.36</sub> Si <sub>0.1</sub> ) N	1100	2750	
8	A1 <sub>0.48</sub> Ti <sub>0.32</sub> Si <sub>0.2</sub>	N <sub>2</sub>	(A1 <sub>0.5</sub> Ti <sub>0.3</sub> Si <sub>0.2</sub> ) N	1120	1900	比較例

【0018】表1から明らかなように、従来例の(A 1, Ti)N皮膜(No.1)は、820℃で酸化が開始 するのに対し、本発明に係る硬質皮膜(No.3~7)の 酸化開始温度はいずれも870℃以上であり、耐酸化性 が向上している。No.2はSi量が少ない場合の比較例 であり、酸化開始温度が低く耐酸化性の向上が認められ ない。

#### 【0019】<u>実施例2</u>

基材として超硬チップを用い、皮膜の厚みを10μmに 50 皮膜硬さが著しく低下している。

する以外は、実施例1と同じ方法で試験片を作製した。 試験片に形成された皮膜のマイクロビッカース硬さを荷 重100gで測定したところ、表1に併記する結果が得 られた。表1より明らかなように、本発明に係る皮膜 (No.3~7)は従来例である(A1, Ti) N皮膜 (No.1)と比較してより高い硬度を示している。一 方、No.8はSi量が多過ぎる場合の比較例であり、 皮膜の結晶構造が立方晶から六方晶へ変化している為、 皮膜の結晶構造が立方晶から六方晶へ変化している為、 /

#### 【0020】実施例3

超硬合金を基材として外径10mmの2枚刃エンドミルを作製し、夫々のエンドミルの刃部表面に表2に示す組成の硬質皮膜を4μmの厚さで形成した。硬質皮膜の形成方法としては、No.2だけはるつば蒸着方式のイオンプレーティング法を用い、それ以外の硬質皮膜はアーク放電方式イオンプレーティング法により形成した。アーク放電方式の成膜条件としてはいずれも、基板温度を400℃とし、バイアス電圧を−150 V印加し、反応ガスは7×10<sup>-3</sup> Torrで成膜した。

【0021】得られた硬質皮膜被覆エンドミルを用いて、下記条件の切削試験を行ない、エンドミル切れ刃逃げ面の摩耗量を測定した。結果は表2および図1に示 \*

\*す。

(切削条件)

切削方法: 側面切削ダウンカット

被削材 : SKD11 (硬さHB219) 切込み : Rd 1mm×Ad 10mm

切削速度:60m/min

送り : 0.07mm/tooth(270mm/m

8

in)

切削油 :エアーブロー

10 切削長 : 20 m

[0022]

【表 2】

No.	成膜方法	皮膜组成	逃げ面摩耗量 (mm)	備考
1	アーク放電方式IP法	(A1 <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.4</sub> ) N	0.056	
2	るつば蒸着方式IP法	Ti (N <sub>0.8</sub> C <sub>0.2</sub> )	0.140	従来例
3	アーク放電方式【P法	(A 1 0.6 Ti 0.39 Si 0.01) N	0.038	
4	アーク放電方式IP法	(A1 <sub>0.58</sub> Ti <sub>0.39</sub> Si <sub>0.03</sub> ) N	0.032	実
5	アーク放電方式【P法	(A1 <sub>0.57</sub> Ti <sub>0.38</sub> Si <sub>0.05</sub> ) N	0.039	施
6	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.54</sub> Ti <sub>0.36</sub> Si <sub>0.1</sub> ) N	0.047	<del>(9</del> 1)
7	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.5</sub> Ti <sub>0.3</sub> Si <sub>0.2</sub> ) N	0.210	比較例

【0023】表2および図1の結果から明らかなように、本発明に係る硬質皮膜被覆エンドミル(No.3~6)は、従来例(No.1,2)と比較して逃げ面摩耗 30 量が少なくフランク摩耗に対する耐摩耗性が優れている。No.7はSi量が多過ぎる場合の比較例であり、逃げ面摩耗量が多く、耐摩耗性が十分でない。

# 【0024】<u>実施例4</u>

JIS規格SKH51相当の高速度工具鋼を基材として 外径10mmのJIS規格ドリルを作製し、実施例3と 同じ方法でドリル刃部表面に表3に組成を示す硬質皮膜 を形成した。

【0025】得られた硬質皮膜被覆ドリルを用いて、下

記条件の切削試験を行ない切削寿命を調べた。結果は表 3に示す。

# 30 (切削条件)

切削方法: 穴明け加工、各5本切削 被削材 : S55C(硬さHB220)

切削速度:30m/min

送り : 0. 15mm/rev

切削長さ:30mm(貫通穴)

切削油 :水溶性エマルジョン型切削油

[0026]

【表3】

u	

	,			10
Na	成膜方法	皮膜組成	平均穴明け 個数	備考
1	アーク放電方式IP法	(Al <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.4</sub> ) N	638	AM ets Izel
2	るつば蒸着方式 I P法	Ti (N <sub>0.8</sub> C <sub>0.2</sub> )	322	<b>従来例</b>
3	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.6</sub> Ti <sub>0.39</sub> Si <sub>0.01</sub> ) N	755	
4	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.58</sub> Ti <sub>0.39</sub> Si <sub>0.03</sub> ) N	988	実
5	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.57</sub> Ti <sub>0.38</sub> Si <sub>0.05</sub> ) N	866	施
6	アーク放電方式 I P法	(A1 <sub>0.54</sub> Ti <sub>0.36</sub> Si <sub>0.1</sub> ) N	792	例
7	アーク放電方式IP法	(A1 <sub>0.5</sub> Ti <sub>0.3</sub> Si <sub>0.2</sub> ) N	180	比較例

【0027】表3の結果から明らかなように、本発明に 係る硬質皮膜被覆ドリル (No. 3~6) は、従来例 (No. 1, 2) と比較して平均穴明け個数が多く切削 寿命が長い。No. 7はSi量が多過ぎる場合の比較例 であり、平均穴明け個数が少なく、切削寿命が短い。

### 【0028】実施例5

JIS規格SKD61相当の金型材を用いて、寸法40 ×20×5mmの基材 (No. 1~3) を作製し、夫々 の基材に実施例1と同様の方法で厚さ5μmの硬質皮膜 を形成した。表4に示すとおり、No. 1の基材にはT\* \*i N皮膜を形成し、No. 2の基材には(Alo.5 Ti 0.5 ) N皮膜を形成し、No. 3の基材には (Alo.58 Tio.39 Sio.03) N皮膜を形成し、下記の条件で熱サ イクル試験を行ない耐久性を調査した。結果は表4に示

10

# 20 (熱サイクル試験条件)

高温槽:800℃ - 保持時間:110秒 低温槽: 水冷 - 保持時間: 10秒

[0029]

【表 4】

符号	皮膜組成	クラック発生のサイクル数	備考
1	TiN	150	従来例
2	(A1 <sub>0.5</sub> Ti <sub>0.5</sub> ) N	635	עבאכנאן
3	(A1 <sub>0.58</sub> Ti <sub>0.39</sub> Si <sub>0.03</sub> ) N	960	実施例

【0030】表4の結果から明らかな通り、本発明に係 る硬質皮膜 (No. 3) は従来例の硬質皮膜 (No. 1, 2) と比較して熱サイクルに対しても優れた特性を 示す。

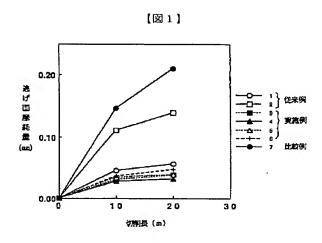
# [0031]

【発明の効果】本発明は以上の様に構成されており、従 来のTiN皮膜や(Ti, Al) N皮膜と比較しても優 40 削長の関係を表すグラフである。

れた耐摩耗性および耐酸化性を示す硬質皮膜が得られる こととなり、さらに上記硬質皮膜を部材表面に被覆する ことにより優れた耐摩耗性及び耐酸化性を発揮する高硬 度部材が提供できることとなった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で得た表面被覆工具の逃げ面摩耗量と切



フロントページの続き

(56) 参考文献 特開 平5-92304 (JP, A)

特開 平4-224104 (JP, A)

特開 平2-194159 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.<sup>6</sup>, DB名) C23C 14/00 - 14/58